撮像素子の高機能化と小型化

須 川 成 利

High-Functionality and Miniaturization Technologies in Image Sensors

Shigetoshi SUGAWA

This paper describes the technology trends of recent high functionality and miniaturization of the imaging devices promoting the introduction of new technologies about color separation, wide dynamic range, resolution improvement, high frame rate, image plane phase difference autofocus and stacked structure.

Key words: image sensor, CMOS, CCD, high functionality, miniaturization

画像入力機器の目となる撮像素子は、ここ10年あまりの 間に、charge coupled device (CCD) 撮像素子から complementary metal oxide semiconductor (CMOS) 撮像素子へ の転換が進み、性能面、機能面で大きな進展を遂げてきて いる。中でも、ディジタルカメラに使用される撮像素子 は、現在、スマートフォンカメラ用の小型の光学フォー マット1/3.2"や1/2.8"から、コンパクトカメラ用の1/2.3" や1/1.7"、さらには一眼レフカメラ用の大型の APS-C や 35 mm フルサイズまで、撮像受光面積として実に 50 倍以 上異なるものが使用され、大いに多様化が進んでいる.

撮像素子全体としては、CMOS 化されて低消費電力化 が図られると同時に多画素化され、高い解像度の静止画撮 影だけでなく、フルハイビジョンの動画撮影も当たり前の ように行えるようになった。暗時ノイズも、列ごとに増幅 器やアナログ・ディジタル (analog to digital, AD) 変換器 を設置するなどにより、1電子程度のレベルまで低減され てきた。

小型撮像素子においては、画素サイズが1µm角程度ま で縮小され、また、光導波路構造や裏面照射構造を導入し て量子効率(quantum efficienty, QE)がほぼ100%に達し た.最近では、受光部と信号処理部を別チップとした積層 型撮像素子も登場し、レンズ一体型実装技術の進化と併 せ、ますます撮像ユニットの体積を縮小させつつある。

また、コンパクトカメラ市場への大型撮像素子の導入が

進みつつある中で,十二分な画素数を有する撮像素子と後 段の高度な信号処理との連携が進み,光学ローパスフィル ターを使用しなくても偽色やモアレが抑制された高解像度 高画質カメラや像面位相差 auto focus (AF)を組み込んだ ミラーレスカメラなどが次々と登場し,新しい撮像技術の 流れが始まっている.

結果として,ほとんどのモバイル機器にかなり良質な撮 像素子が標準的に搭載されるに至った現在,今後の製品の 差別化,高付加価値化をどのように図るべきかについて, 次なる模索が始まりつつある.今までどちらかというと個 別に技術レベルを向上させてきた光学系,撮像素子,信号 処理の各技術は,画像入力システム技術として融合が進 み,今までにない性能,機能を高め,進化しようとしている.

本稿では,進展が著しいこうした撮像素子の高機能化と 小型化について,最近の技術動向を解説する.

1. 新しい色分離:カラーフィルター配列の改良,カ ラーフィルターレス

撮像素子が果たすべき機能は,色,光量,空間,時間の 分離抽出および合焦点の情報などの提供である.

現在,ディジタルカメラの撮像素子における色情報は, 原色系の赤緑青(RGB)のオンチップカラーフィルターを ベイヤー配列にして画素上に設け,可視光を3色に分離す るのが基本型である.最近の正面照射+光導波路構造¹⁾

東北大学大学院工学研究科(〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-11) E-mail: sugawa@most.tohoku.ac.jp



図1 カラーフィルターの配列の例. (a) ベイヤー配列, (b) WRGB 配列⁴⁾, (c) クリアビット配列^{*1}, (d) X-Trans 配列³⁾.

や裏面照射+反射防止膜構造²⁾などの技術の登場によ り,量子効率がほぼ100%になったことは,入射光量ロス の残りの原因が,ほぼカラーフィルターの光吸収のみにな るところまで改善が進んだことを意味する.各画素で RGBの1色ずつを選択透過させるということは,約3分の 2の光が吸収され,利用される光は約3分の1になってい ることになる.したがって,光量ロスを抑制した新しいカ ラーフィルター配列の改良や,カラーフィルターレスによ る色分離方法に注目が集まりつつある.

カラーフィルターによる入射光量ロスをなくす技術とし て、従来からダイクロイックミラーを使用した3板技術が あるが、これは、大きさ・重さ・コスト増を考えると、今 後とも民生用ディジタルカメラでは採用されにくい.

そこで、最近まで、ベイヤー配列にこだわらない新しい カラーフィルター配列の検討がなされ、例えば、輝度・解 像度を決めるG画素の割合を増やす*^{1,3}、光透過率の高い 白(W)画素を導入する⁴⁾などの技術が開発されている。 ただし、W画素は他の色の画素に比べて入射光量が2~3 倍以上増えるので、後述する広ダイナミックレンジ (wide dynamic range, WDR)技術と組み合わせないと、導 入の意義は半減する。図1に、新しいカラーフィルター配 列の例を示す。

一方で、カラーフィルターを使用せず光量ロスなしに色 分離をする技術も実現されている。今までに、シリコン (Si) へ入射した光の侵入深さが波長により異なることを 利用して、3 層縦に積んだフォトダイオード (PD) で色を 分離する*²、有機光電膜を積層して RGB3 色に分離す る⁵⁾、などの技術が開発されている。最近、マイクロ分光 素子とよばれる、微細な領域で光の波長よりも薄い板状の 高屈折率材料と、その周辺材料との屈折率差によって回折 現象を生じさせ, W+R, W-R, W+B, W-B に色分離を 行う技術も登場した^{*3}.

このようにさまざまな色分離技術が現実化してきたの は、半導体 LSI 技術の進化により、以前よりも複雑かつ高 度な色処理技術をカメラ内に搭載することが許されるよう になってきたことによる.したがって、今後、LSI のさら なる性能向上とともに、ますます新しい色処理方式が提案 され、進展していくであろう.

2. 光量範囲の拡大:広ダイナミックレンジ化

暗いものから明るいものまで、人間の目・脳で感じるの と同等ないしはそれ以上の広い光量範囲の被写体を撮影し たい、すなわちダイナミックレンジ(DR)の広い撮像が 行えるカメラが欲しい、という要望がよく聞かれる.

DRは, 暗時ノイズ信号と飽和信号に対応する光量の比 として定義される. 暗い側への DR 拡大は暗時ノイズで決 まるが, すでに暗時ノイズが1電子レベル程度まで低減さ れている.

一方,飽和光量を上昇させ、明るい側へDRを拡大する 方法についても、今までに多くの技術が提案されている. 飽和は、おもに PD および電荷電圧変化部のフローティン グディフュージョン (FD) に蓄えられる最大電荷量で決 まる.特に FD 部には、電荷電圧変換ゲイン (conversion gain, CG)を高めると最大蓄積電荷量が減るという、ト レードオフ関係が内在する.そこで、標準的な撮像素子で は、バランスを考え、60~100 μ V/e⁻程度のCGと、60~ 75 dB 程度の DR にして実用化されている.

飽和の拡大は、長短の露光時間の撮影を複数行い、画像 処理により合成した DR の広い映像信号を得た後、例えば 局所ヒストグラム平均化処理などにより、輝度値の集中し

^{*1} http://www.sony.jp/products/Consumer/handycam/PRODUCTS/special/02cmos.html

^{*2} http://www.foveon.com/article.php?a=67

^{*3} http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/02/jn130204-4/jn130204-4.html

た部分にその画素数に応じた輝度範囲を割り当てて累積輝 度ヒストグラムの偏りをマッピングすることで、人間の見 え方に近い自然な WDR イメージが再現できるようになっ てきている*4.

ただし、短時間露光の光信号は、蓄積時間比の逆数を乗 じて長時間露光側の信号と合成されるので、暗時ノイズの 影響を受けやすい.そこで、こうしたノイズの影響を低減 する方法として、中間電圧転送を用いた画素ごとの蓄積時 間制御による方式が提案されている^{6,7)}.短時間露光動作 を、リセット状態から始めるのでなく、光信号電荷が残っ ている中間電圧から開始することで、長短露光のつなぎ目 におけるノイズの影響を低減して S/N 比を改善し、良好 な画質を保っている.複数回露光時間による WDR 化技術 は、動く被写体を撮影する際の画像ずれが懸念されるが、 読み出し動作を高速化し複数回露光の撮影時間差を小さく したり、画像処理により動きずれを補正するなどの工夫を 施したりすることで実用化されている.

複数回の露光を行わずに1回の露光で線形応答の光電変換特性のDRを拡大する技術としては、CCD撮像素子において、画素ごとに低照度用と高照度用の感度の異なるPDを2つずつ設置し、それらの出力を合成してWDR信号を得る撮像素子が実用化されている⁸.

また、CMOS撮像素子では、列ごとに高低2つのゲイン をもつアンプとAD変換器を設置して、同一の水平ブラン キング期間内に高ゲイン信号と低ゲイン信号を得て、 WDRの撮影を行うCMOS撮像素子が報告されている⁹⁾.

さらに、CMOS 撮像素子において、画素ごとに、飽和 を超える強い光照射を受けた際に PD からあふれた光電荷 を同一蓄積時間内に蓄積する横型オーバーフロー容量 (lateral overflow integration capacitor, LOFIC)を設置し DRを拡大する方法が提案されている^{10,11)}. この撮像素子 では、飽和前側信号電荷と過飽和側信号電荷を混合して過 飽和側信号を得ており、過飽和側信号には最小でも PD 飽 和に近い信号電荷が存在し、暗時ノイズの影響を受けにく い. LOFIC CMOS撮像素子は、単なる WDR 撮像素子と使 用されるだけでなく、FD および PD の構造設計と飽和性 能設計を独立に最適化できるという特長をもっている. こ れを生かして、200 μ V/e⁻の CG と 10⁵e の飽和電子量を両 立し感度と飽和のトレードオフを 20 倍以上改善した高感 度 WDR CMOS 撮像素子¹²⁾、PD の内部電界を構造的に緩 和して暗電流を 1 桁以下に低減した高耐熱 CMOS 撮像素 子¹³⁾, RGBW の4色のカラー画素ごとに LOFIC 容量を変 化させ,飽和露光量を色間でほぼ同一にした CMOS 撮像 素子¹⁴⁾ などの開発がなされている.また,LOFIC CMOS 撮像素子は,複数回露光に応用しても,1回の露光におけ る飽和信号が高いので,露光のつなぎ目の S/N 比を高く 保てるという特長があり,少ない多重露光回数で 185 dB (3回露光),200 dB (4回露光)を超える高 S/N なダイナ ミックレンジ性能を実現している^{15,16)}.また,最近,2.8 μ m 角画素のグローバルシャッター LOFIC CMOS 撮像素 子の開発もなされている¹⁷⁾.

DR 性能の差は誰にでも見た目でわかるものであること からも,高品質な DR 拡大技術はディジタルカメラの付加 価値を高めていく手段として有効に作用していくであろう.

3. 空間情報の高精細分離:解像度の向上

解像度向上のために、画素サイズを縮小し、画素数を増 やす努力が継続されており、現在、画素ピッチは製品で 1.1μm、開発品で0.9μmを下回るところまで進んでいる. これは、画素サイズがレンズ・しぼりを通過した光の回折 広がりと同等、ないしはそれ以下にまで達したことに相当 する. そろそろ単純な画素サイズ縮小競争は終わりに近づ くかもしれない.

画素数が一般的に表示または印刷して鑑賞するのに必要 な数以上に十分に増加できるようになったことで,最近, オーバーサンプリングという発想が出てきた.これは,ひ とつひとつの画素の解像度をフルに出そうという今までの 撮像素子の考え方とは異なる.

例えば、東芝が開発した 4100 万画素の CMOS 撮像素子 を搭載したノキアの携帯カメラでは、7 画素程度の複数の 画素から得られる信号を1つの画素信号として処理するこ とにより、色再現性、DR、ノイズ性能を改善しているだ けでなく、光学ズームなしでセンサーの有効面積を変化さ せることで、高画質なズームを可能にしている^{*5}.

また, 富士フイルムは, 縦横方向に必ず RGB の画素を 存在させた 6×6 画素を単位とした非周期性の高いカラー フィルター配列の画素をもつ CMOS 撮像素子を開発し, 光学ローパスフィルターなしでモアレや偽色の発生を抑え た高い解像度を実現している³⁾.

ベイヤー配列の2×2 画素単位をもとにした画像処理で は、光学ローパスフィルターをなくすと、折り返された高 周波成分(モアレや偽色)はもともとある低周波成分と区

^{*4} http://www.apical.co.uk/products/iridix-hdr/

^{*5} http://press.nokia.com/2012/02/27/nokia-808-pureview-ushers-in-a-revolution-in-smartp

別できないため、一般的には取り除くことが難しい. 多数 の画素を使用したオーバーサンプリングだからこそ、破綻 のない良質な画像再現が可能となる.

将来,35 mm フルサイズのような大型の撮像素子が数 億を超える画素数になったとき,どんな写真を撮ることが できるようになるのか,興味は尽きない.

さらにまた,最近,オーバーサンプリングの究極型とし て,極微小画素による空間サンプリングを行う撮像素子の アイデアも提案されている^{18,19)}. Airy Disk よりも極端に 小さい極微細画素を使用できるようになると,解像度限界 の考え方は変わってくるであろう.

4. 時間軸の切り取り:多画素化と高速化の両立

ディジタルカメラ用途においては、フルハイビジョン動 画撮像はもはや標準性能である.そして、高速撮像は、専 門家でなくとも誰でも身近で行えるようになってきた.今 後のディジタルカメラにおいてどれほどの高速撮影性能が 求められるかは確定できないが、最近の高速撮像技術その ものの進展は著しい.

ソニーは,裏面照射型の1.65 μm角4 画素共用1030 万画 素で12 ビット22 fps (画素読み出しレート230 Mpixle/s, 出力ディジタルデータレート2.7 Gb/s)²⁰⁾,および正面照 射型の4.2 μm角千鳥画素配置の1770 万画素12 ビット120 fps (2.1 Gpixle/s, 34.8 Gb/s)²¹⁾の高速 CMOS 撮像素子を 相次いで報告している.

さらに NHK ほかは、上述した 2 段サイクリック 12 ビッ ト AD 変換回路技術を発展させて、3300 万画素 120 fps (3.96 Gpixel/s,出力データレート 51.2 Gb/s)のフルス ペックのスーパーハイビジョン対応の CMOS 撮像素子を 開発している²²⁾.この撮像素子は、上下 48 並列、合計 96 並列の LVDS 出力を設けている.

また,科学計測用途においては,最近,多画素化・多コ マ化を達成した200万~1000万コマ/秒を超えるフレーム レートの超高速撮像素子が開発され,超高速ビデオカメラ の性能向上が活発化している²³⁻²⁶.

これらの高速撮像素子技術の技術は、いずれディジタル カメラにも展開され、今後新たな付加価値を生み出してい くに違いない.

5. 合焦情報の提供:像面位相差 AF

最近, ミラーレスカメラやライブビュー撮影を行う一眼

レフカメラにおいて,撮像素子のなかに被写体との距離を 検出する位相差画素を組み込んだ像面位相差 AF とよばれ る技術が盛んに使用されつつある.

従来,一般的には,ディジタル一眼レフカメラにおいて はハーフミラーで分離した光線を利用した専用の光学系内 位相差 AF センサーを,またコンパクトディジタルカメラ やスマートフォンではコントラスト AF を使用していた. (ただし,1点測距の像面位相差 AF を搭載した最初のもの は,富士フイルムのコンパクトカメラであった*6.)

レンズ交換式のディジタルカメラにおいて,ニコンは 1"の CMOS 撮像素子に 73 点の位相差 AF を搭載し,高速 かつ精度の高い AF 性能が実現できることを示した*7.そ の後,他社も続々と像面位相差 AF 画素を内蔵した撮像素 子を実用化し,コントラスト AF と像面位相差 AF の併用 のみならず,光学系内位相差 AF と像面位相差 AF を組み 合わせるという方式も登場し,AF の速度と精度は飛躍的 に向上してきている.

像面位相差 AF 画素の配置は各社とも独自のものを採用 しており,直線状に配置するもの,疑似ランダムに配置す るものなどさまざまである.いずれにしろ,映像信号抽出 には影響のないような配置が選択されているが,これも画 素数が十分にあることと,画像処理信号処理が高度化した ことの効果である.

今後,レンズ一体型ディジタルカメラなどにおいても, 像面位相差 AF が標準的に搭載されていく可能性も否定で きない.

6. 小型化:積層構造

携帯やスマートフォン用の撮像素子においては,撮像ユ ニットの小型化・薄型化の要求がきわめて強い.レンズー 体型パッケージは必須の技術である.

裏面照射構造が形成できるようになったことにより,深い微小穴を形成する Si 貫通接続技術を用いずとも,回路 素子が形成されたチップ上に撮像素子を張り合わせやすく なった.

最近,ソニーは,裏面照射型画素を有する CMOS 撮像 素子チップが形成された基板を信号処理回路チップが形成 された支持基板上に積層し,列部分において数画素単位で 上下の信号線を接続した積層型 CMOS 撮像素子を発表し た²⁷⁾.積層型にすることで,従来に比べ 1/4" 800 万画素 の SOC 型撮像素子で,半分以下の面積となる.また,従

^{*6} http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0415.html *7 http://www.nikon.co.jp/news/2011/0921_nikon-1_01.htm

来の撮像素子では、画素の領域と周辺回路領域が Si 基板 に存在しており、画素と回路領域で特化したプロセス技術 を施しにくかったが、その律速もなくなり、それぞれに最 適化を図れるようになった.

また、オリンパスは、4.3 μm 画素ピッチ、36 万画素 で、4 画素ごとに上下チップを接続した積層型 CMOS イ メージセンサーを開発し、第2チップに画素ごとの保持容 量を設置して、寄生光感度(迷光の照射や光発生電荷の拡 散により保持容量に現れる偽信号の感度)-160 dB のグ ローバルシャッター性能を実現している²⁸⁾.

積層構造は,小型撮像素子から始まっているが,今後, 大型撮像素子においても,より低ノイズで高度な信号処理 を撮像素子回路レベルで実現しようとした場合,積層構造 は有用となろう.

以上,本稿では,進展が著しい撮像素子の高機能化と小型化に関し,カラーフィルター配列の改良やカラーフィル ターレスによる新しい色分離,広ダイナミックレンジ化に よる光量範囲の拡大,オーバーサンプリングによる解像度 の向上,多画素化と高速化の両立,像面位相差 AF,積層 構造による小型化などについて,最近の技術動向を解説 した.

しかしながら,現時点では,すべての点で究極の性能・ 機能をもつ「理想の撮像素子」はいまだ実現できていな い.例えば,400 μV/e⁻を超える光電変換ゲイン,0.15 電 子程度以下の読み出しノイズで,画素出力信号をディジタ ル信号に変換できれば,雑音なしに1光子信号を1ディジ タル値に変換できることが知られている²⁰⁾.これを,超解 像技術による光回折抑制,カラーフィルターレスによる色 分離技術,極微小画素技術によるオーバーサンプリング, 量子効率100%構造技術,高速サンプリング技術,高S/N 高速 AD 変換技術などと組み合わせたら,間違いなく大き なパラダイムの変換が起きる.近い将来,これらにもう少 しで手が届くところまでたどり着くであろう.今後の撮像 素子の技術の進展に大いに期待したい.

文 献

- H. Watanabe, J. Hirai, M. Katsuno, K. Tachikawa, S. Tsuji, M. Kataoka, S. Kawagishi, H. Kubo, H. Yano, S. Suzuki, G. Okazaki, K. Yamamoto, H. Fujinaka, T. Fujioka and M. Suzuki: "A 1.4 μm front-side illuminated image sensor with novel light guiding structure consisting of stacked lightpipes," *IEEE International Electron Devices Meeting, Technical Digest*, 8.3.1–8.3.4 (2011).
- 2) S. Iwabuchi, Y. Maruyama, Y. Ohgishi, M. Muramatsu, N. Karasawa and T. Hirayama: "A back-illuminated high-sensitivity small-pixel color CMOS image sensor with flexible layout of metal wiring," *International Solid-State Circuits Conference*,

Digest of Technical Papers (2006) pp. 302-303.

- 3) 田中誠二,河村典子,田丸雅也: "X-Trans CMOS の開発", 映像情報メディア学会技術報告, 36-18 (2012) 1-4.
- 4) H. Honda, Y. Iida, Y. Egawa and H. Seki: "A Color CMOS imager with 4×4 white-RGB color filter array for increased lowillumination signal-to-noise ratio," IEEE Trans. Electron Devices, 56 (2009) 2398–2402.
- S. Takada, M. Ihama, M. Inuiya, T. Komatsu and T. Saito: "CMOS color image sensor with overlaid organic photoconductive layers having narrow absorption band," Proc. SPIE-IS&T, 6502 (2007) 650207.
- 6) Y. Egawa, N. Tanaka, N. Kawai, H. Seki, A. Nakao, H. Honda, Y. Iida and M. Monoi: "A white-RGB CFA-patterned CMOS image sensor with wide dynamic range," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers* (2008) pp. 52–53.
- 7) Y. Oike, A. Toda, T. Taura, A. Kato, H. Sato, M. Kasai and T. Narabu: "A 121.8 dB dynamic range CMOS image sensor using pixel-variation-free midpoint potential drive and overlapping multiple exposures," *Proc. International Image Sensor Workshop* (2007) pp. 30–33.
- 8) 小田和也,小林寛和,竹村和彦,竹内 豊,山田哲夫:"広ダ イナミックレンジ撮像素子の開発―第4世代スーパー CCD ハ ニカム―",映像情報メディア学会技術報告,27, No. 25 (2003) 17-20.
- B. Fowler, C. Liu, S. Mims, J. Balicki, W. Li, H. Do and P. Vu: "Wide dynamic range low light level CMOS image sensor," *International Image Sensor Workshop*, Paper 48 (2009) pp. 340– 343.
- 10) S. Sugawa, N. Akahane, S. Adachi, K. Mori, T. Ishiuchi and K. Mizobuchi: "A 100 dB dynamic range CMOS image sensor using a lateral overflow integration capacitor," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers* (2005) pp. 352–353.
- 11) N. Akahane, S. Adachi, K. Mizobuchi and S. Sugawa: "Optimum design of conversion gain and full well capacity in CMOS image sensor with lateral overflow integration capacitor," IEEE Trans. Electron Devices, 56 (2009) 2429–2435.
- 12) S. Adachi, W. Lee, N. Akahane, H. Oshikubo, K. Mizobuchi and S. Sugawa: "A 200-μ V/e- CMOS image sensor with 100-ke- full well capacity," IEEE J. Solid-State Circuits, 43 (2008) 823–830.
- 13) 溝渕孝一,足立理,山下友和,岡村誠一郎,押久保弘道, 赤羽奈々,須川成利:"高温下の耐性・撮像性能を改善した 広ダイナミックレンジ CMOS イメージセンサ",映像情報メ ディア学会誌,62 (2008) 368-375.
- 14) S. Kawada, S. Sakai, N. Akahane, K. Mizobuchi and S. Sugawa: "A color-independent saturation, linear response, wide dynamic range CMOS image sensor with retinal rod- and cone-like color pixels," *Symposium on VLSI Circuits, Digest of Technical Papers* (2009) pp. 180–181.
- 15) N. Ide, W. Lee, N. Akahane and S. Sugawa: "A wide DR and linear response CMOS image sensor with three photocurrent integrations in photodiodes, lateral overflow capacitors, and column capacitors," IEEE J. Solid-State Circuits, 43 (2008) 1577–1587.
- 16)井出典子,赤羽奈々,須川成利:"画素容量・列容量電荷電圧 変換を組み合わせた多重露光線形応答広ダイナミックレンジ CMOS イメージセンサ",映像情報メディア学会誌,64 (2010) 335-342.
- 17) S. Sakai, Y. Tashiro, R. Kuroda and S. Sugawa: "A 2.8 μm pixelpitch 55 ke- full-well capacity global-shutter CMOS image sensor using lateral overflow integration capacitor," *International Conference on Solid State Devices and Materials*, Extended Abstracts (2012) pp. 1109–1110.

- 18) E. R. Fossum: "What to do with sub-diffraction-limit (SDL) pixels? A proposal for a gigapixel digital film sensor (DFS)," *Proc. International Image Sensor Workshop* (2005) pp. 214–217.
- 19) K. Fife, A. E. Gamal and H.-S. P. Wong: "A 3Mpixel multiaperture image sensor with 0.7 μm pixels in 0.11 μm CMOS," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers* (2008) 48–49.
- 20) H. Wakabayashi, K. Yamaguchi, M. Okano, S. Kuramochi, O. Kumagai, S. Sakane, M. Ito, M. Hatano, M. Kikuchi, Y. Yamagata, T. Shikanai, K. Koseki, K. Mabuchi, Y. Maruyama, K. Akiyama, E. Miyata, T. Honda, M. Ohashi and T. Nomoto: "A 1/2.3-inch 10.3Mpixel 50frame/s back-illuminated CMOS image sensor," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers* (2010) pp. 410-411.
- 21) T. Toyama, K. Mishina, H. Tsuchiya, T. Ichikawa, H. Iwaki, Y. Gendai, H. Murakami, K. Takamiya, H. Shiroshita, Y. Muramatsu and T. Furusawa: "A 17.7Mpixel 120 fps CMOS image sensor with 34.8 Gb/s readout," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers* (2011) pp. 420– 421.
- 22) K. Kitamura, T. Watabe, Y. Sadanaga, T. Sawamoto, T. Kosugi, T. Akahori, T. Iida, K. Isobe, T. Watanabe, H. Shimamoto, H. Ohtake, S. Aoyama, S. Kawahito and N. Egami: "A 33Mpixel, 120 fps CMOS image sensor for UDTV application with twostage column-parallel cyclic ADCs," *Proc. International Image Sensor Workshop* (2011) pp. 343–346.
- 23) T. G. Etoh, D. H. Nguyen, S. V. T. Dao, C. L. Vo, M. Tanaka, K. Takehara, T. Okinaka, H. van Kuijk, W. Klaassens, J. Bosiers, M. Lesser, D. Ouellette, H. Maruyama, T. Hayashida and T. Arai: "A 16Mfps 165kpixel backside-illuminated CCD," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical*

Papers (2011) pp. 406-407.

- 24) T. Arai, J. Yonai, T. Hayashida, H. Ohtake, H. van Kuijk and T. G. Etoh: "Back-side-illuminated image sensor with burst capturing speed of 5.2 Tpixel per second," Proc. SPIE, 8659 (2013) 865904.
- 25) Y. Tochigi, K. Hanzawa, Y. Kato, R. Kuroda, H. Mutoh, R. Hirose, H. Tominaga, K. Takubo, Y. Kondo and S. Sugawa: "A global-shutter CMOS image sensor with readout speed of 1Tpixel/s burst and 780Mpixel/s continuous," IEEE J. Solid-State Circuits, 48 (2013) 329–338.
- 26) J. Crooks, B. Marsh, R. Turchetta, K. Taylor, W. Chan, A. Lahav and A. Fenigstein: "Kirana: A solid-state megapixel uCMOS image sensor for ultrahigh speed imaging," Proc. SPIE, 8659 (2013) 865903.
- 27) S. Sukegawa, T. Umebayashi, T. Nakajima, H. Kawanobe, K. Koseki, I. Hirota, T. Haruta, M. Kasai, K. Fukumoto, T. Wakano, K. Inoue, H. Takahashi, T. Nagano, Y. Nitta, T. Hirayama and N. Fukushima: "A 1/4-inch 8Mpixel back-illuminated stacked CMOS image sensor," *International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers*, 27.4 (2013).
- 28) J. Aoki, Y. Takemoto, K. Kobayashi, N. Sakaguchi, M. Tsukimura, N. Takazawa, H. Kato, T. Kondo, H. Saito, Y. Gomi and Y. Tadaki: "A rolling-shutter distortion-free 3D stacked image sensor with -160dB parasitic light sensitivity in-pixel storage node," *Proc. International Solid-State Circuits Conference, Digest of Technical Papers*, 27.3 (2013).
- 29) J. R. Janesick: *Photon Transfer DN→λ* (SPIE Press, Washington, 2007) pp. 21–34.

(2013年2月12日受理)